

	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5
13h30-14h00	Accueil C. Deparis puis Exposé de présentation par Maxime HUGUES Salle de conférence				
14h00-14h20	La technologie une étape indispensable pour réaliser un composant par Blandine ALLOING Salle de conférence				
14h25	Croissance de Graphène par EPV	Croissance de ZnO par EJM	LIDAR		AFM
14h50	AFM	MEB	Croissance de Graphène par EPV	Croissance de ZnO par EJM	LIDAR
15h15	LIDAR		AFM	MEB	Croissance de Nitrures par EPVOM
15h45-16h15	Exposé : Impacts environnementaux des TIC par C. DEPARIS salle de conférence				
16h15-16h40	Clôture à la cafétéria				

Acronymes (français – anglais)

MFA : Microscopie à Force Atomique

EJM : Epitaxie par Jets Moléculaires

**EPV(OM) : Epitaxie en Phase Vapeur
(Organo- Métalliques)**

MEB : Microscopie Electronique à Balayage

AFM : atomic force microscopy

MBE : molecular beam epitaxy

(MO)CVD : (metal organic) chemical vapor deposition

SEM : scanning electronic microscopy

LIDAR : Laser Imaging Detection and Ranging

TIC: Technologies de l'Information et de la Communication